

ワークマスク

ターゲット&シャッター

基板XY移動ステージ

チャンバー内部

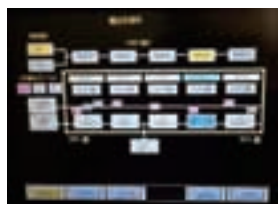
## ワンボタンで同時スパッタリング & 成膜完了！

従来のスパッタ装置では困難であった同一バッチ内での複数材料のスパッタリング。当製品はワーク側に異なる形状のマスクを装備し、大気に曝される事なく成膜まで可能にしました。

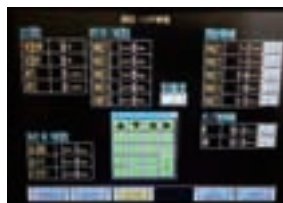
- ◆ワンボタンで吸気・排気・成膜まで完了
- ◆1インチスパッタカソードで材料費を節減
- ◆省スペースかつ機能美
- ◆充実のオプション&カスタマイズ



制御画面 (SPUTTER)



制御画面 (TRANSFER)

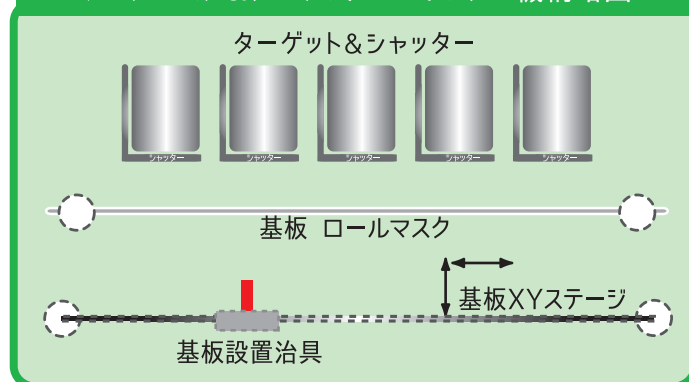


制御画面 (SETTING)



制御画面 (ALARM)

### ワークマスク&ターゲット&シャッター機構略図



本スパッタ装置に関する知的財産は株式会社アツミテック様にあります。

## Specifications

装置構成	成膜チャンバー本体・自立制御盤・チラー・コンプレッサ
処理方法	バッチ処理方式
ワーク投入口	ワークチャンバー手動開閉方式
付属ポート	真空計NW16ポート× 2、ベントポート、サービスポート× 6
スパッタ源	マグネトロン式φ25mm× 5
ターゲット形状	直径1inch 厚み1/8inch
T-S間距離	マスク間距離16-100mm可変可能
スパッタリング電源	DC電源500W(空冷式)RF電源500W(空冷式)自動整合器(水冷式)
カソード切替器	最大10接点(RF× 5回路、DC× 5回路)
プロセスガス	3系統 Ar100xsccm,N2100sccm
フロー制御	マスフローコントローラー× 2
メインポンプ	ターボ分子ポンプ× 1
粗引きポンプ	油回転ポンプ× 1
排気方式	大気圧スロー排気式
真空計測	電離真空計× 1、ピラニ真空計× 2、大気圧検知器× 1
ベントライン	ストップバルブ× 1、流量調節バルブ× 1
電装盤	自立制御盤× 1、制御機器、計装類、電源部を搭載
操作関係	PLC搭載によるタッチパネル操作
排気制御	排気系手動/ブロック自動
成膜制御	スパッタ系手動、スパッタ電源タイマー制御
シグナルタワー	パトライト
非常停止ボタン	ロック機能付き(カバー付き)※取付位置:制御盤前面× 1
サイズ	1400(w)× 1000(D)× 1300(H) 700(w)× 1000(D)× 1950(H)※パトライト含まず

※CF4ガス使用について、対応ガス種のマスフローコントローラー、排ガス処理装置につきましては、別途、お打ち合わせが必要です。  
※上記仕様以外の付帯品については、お問い合わせください。

## Option

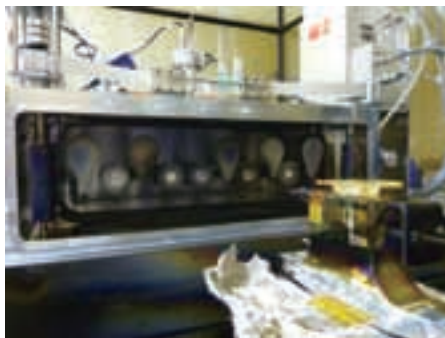
Opt. 複数材料を同時スパッタリング →電源を拡張させることで異なる材料を同時に成膜。

Opt. 膜厚測定 →成膜しながら膜厚を測定させる事でアナログライクな膜厚解析が可能。

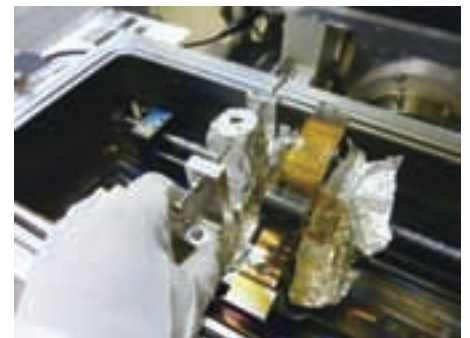
Opt. ワーク治具・ワークマスクのカスタマイズ →より高確率の成功を導く治具はカスタマイズで。



異なる材料を同時に成膜することで再現性がアップ。



アナログライクに膜厚をモニタできる有用性はオプション



左: OPT.膜厚測定用ワーク 右: 通常のワーク

本製品は株式会社アツミテック様の特許(スパッタリング装置)をベースに製品化しております。

- このカタログに記載内容は2015年6月現在のものです。  
カタログの記載事項/仕様はお断りなく変更することがあります。  
詳しい商品情報は右の連絡先または、弊社H.P.にてご確認ください。
- 外為法に基づく注意事項:  
当社製品を輸出または国外へ持ち出す際は、弊社までご相談ください。

**QK九州計測器株式会社**

お電話によるお問い合わせはこちら 092-441-3200